

|                                                                                            |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 都城工業高等専門学校                                                                                 |                                                                                                     | 開講年度 | 平成29年度 (2017年度)                                             |         | 授業科目                                                           | 産業財産権法 |
| 科目基礎情報                                                                                     |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 科目番号                                                                                       | 0043                                                                                                |      | 科目区分                                                        | 一般 / 選択 |                                                                |        |
| 授業形態                                                                                       | 授業                                                                                                  |      | 単位の種別と単位数                                                   | 履修単位: 2 |                                                                |        |
| 開設学科                                                                                       | 機械工学科                                                                                               |      | 対象学年                                                        | 5       |                                                                |        |
| 開設期                                                                                        | 通年                                                                                                  |      | 週時間数                                                        | 2       |                                                                |        |
| 教科書/教材                                                                                     | 伊藤塾・伊藤真(2012)『知的財産法 第4版 (伊藤真実務法律基礎講座3)』弘文堂                                                          |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 担当教員                                                                                       | 吉井 千周                                                                                               |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 到達目標                                                                                       |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 1 知的財産制度を理解することができること。<br>2 特許情報を検索し、特許書類が読めるようになること。<br>3 パテントコンテスト、デザインパテントコンテストに参加すること。 |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
| ルーブリック                                                                                     |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
|                                                                                            | 理想的な到達レベルの目安                                                                                        |      | 標準的な到達レベルの目安                                                |         | 未到達レベルの目安                                                      |        |
| 評価項目1                                                                                      | 産業財産権4法を基盤とした知的財産制度を理解し、知的財産に関連する時事の話題について自分で説明することができる。                                            |      | 産業財産権4法を基盤とした知的財産制度を理解し、知的財産に関連する時事の話題について説明を受けて理解することができる。 |         | 産業財産権4法を基盤とした知的財産制度を断片的に理解し、知的財産に関連する時事の話題を補助を受けながら理解することができる。 |        |
| 評価項目2                                                                                      | 自分で特許情報を検索し、特許書類記事項の記載目的や意味を理解しながら読むことができる。                                                         |      | 自分で特許情報を検索し、特許書類記事項の記載目的や意味を読み、その内容を把握することができる。             |         | 補助を受けながら、特許情報を検索し、特許書類記事項の記載目的や意味を理解できる。                       |        |
| 評価項目3                                                                                      | 知的財産権の活用と管理を独力で行う事ができる。                                                                             |      | 知的財産権の活用と管理を補助を受けて行う事ができる。                                  |         | 知的財産権の活用と管理を補助を受けて行う事ができる。                                     |        |
| 学科の到達目標項目との関係                                                                              |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
| JABEE (b) JABEE (d) JABEE C2                                                               |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 教育方法等                                                                                      |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 概要                                                                                         | 「知的財産権法制のうち、一般的には、特許法、実用新案法、意匠法、商標法からなる「工業所有権四法」を理解する。また、特許権、意匠権、商標権取得のための手段・手続きについてその方法を学ぶ理解を深める。  |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 授業の進め方・方法                                                                                  | 「法学」で学習した法律の考え方、民法関連知識を復習すること。知的財産に関連した時事の話題に関心を持ち、自己学習として調べること。                                    |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 注意点                                                                                        | 法学及び知的財産権制度に関する基礎的な知識を有しており、かつ、これに対する関心をもっていることが望ましい。4年で開講されている「法学」を受講していない学生は、選択することができないので注意すること。 |      |                                                             |         |                                                                |        |
| ポートフォリオ                                                                                    |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
| 授業計画                                                                                       |                                                                                                     |      |                                                             |         |                                                                |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 週    | 授業内容                                                        |         | 週ごとの到達目標                                                       |        |
| 前期                                                                                         | 1stQ                                                                                                | 1週   | 授業計画の説明<br>1. 知的財産権の概要                                      |         | 授業計画・達成目標・成績の評価方法等の説明<br>知的財産保護制度の必要性、権利の意義と種類、知的財産の性質、知的財産の歴史 |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 2週   | 2. 特許法<br>2-1. 特許法概要                                        |         | 特許法概要                                                          |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 3週   | 2-2. 発明                                                     |         | 発明の定義、発明の対象、発明者、職務発明                                           |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 4週   | 2-2. 発明                                                     |         | 発明の定義、発明の対象、発明者、職務発明                                           |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 5週   | 2-3. 特許手続                                                   |         | 特許出願手続、出願審査、出願公開                                               |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 6週   | 2-3. 特許手続                                                   |         | 特許出願手続、出願審査、出願公開                                               |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 7週   | 2-4. 特許権と権利侵害対応                                             |         | 権利の効力、権利の活用、権利の侵害、民事的救済、刑事罰                                    |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 8週   | 2-4. 特許権と権利侵害対応<br>3. 実用新案法                                 |         | 保護対象、手続、特許との相違                                                 |        |
|                                                                                            | 2ndQ                                                                                                | 9週   | 前期中間試験<br>試験答案の返却及び解説                                       |         | 試験問題の解説及びポートフォリオの記入                                            |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 10週  | 4. 特別講義                                                     |         | 外部講師による特別講義                                                    |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 11週  | 5. 特許情報<br>5-1. 明細書                                         |         | 明細書の読み方、書き方                                                    |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 12週  | 5-1. 明細書                                                    |         | 明細書の読み方、書き方                                                    |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 13週  | 5-1. 明細書                                                    |         | 明細書の読み方、書き方                                                    |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 14週  | 5-2. 特許検索                                                   |         | 特許検索システムの使い方                                                   |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 15週  | 5-2. 特許検索                                                   |         | 特許検索システムの使い方                                                   |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 16週  | 試験答案の返却及び解説                                                 |         | 試験問題の解説及びポートフォリオの記入                                            |        |
| 後期                                                                                         | 3rdQ                                                                                                | 1週   | 6. 意匠法<br>6-1. 保護対象と手続                                      |         | 保護対象、権利取得のための手続                                                |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 2週   | 6-1. 保護対象と手続<br>6-2. 意匠権                                    |         | 保護対象、権利取得のための手続<br>意匠権の効力と侵害への対応                               |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 3週   | 6-2. 意匠権                                                    |         | 意匠権の効力と侵害への対応                                                  |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 4週   | 7. 商標法<br>7-1. 保護対象と手続                                      |         | 保護対象、権利取得のための手続                                                |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 5週   | 7-1. 保護対象と手続<br>7-2. 商標権                                    |         | 保護対象、権利取得のための手続<br>商標権の効力と侵害への対応                               |        |
|                                                                                            |                                                                                                     | 6週   | 7-2. 商標権                                                    |         | 商標権の効力と侵害への対応                                                  |        |

|  |      |     |                                       |                       |
|--|------|-----|---------------------------------------|-----------------------|
|  |      | 7週  | 8. 不正競争防止法                            | 保護対象, 救済措置, 罰則        |
|  |      | 8週  | 9. 種苗法                                | 保護対象, 権利の効力           |
|  | 4thQ | 9週  | 後期中間試験<br>試験答案の返却及び解説                 | 試験問題の解説及びポートフォリオの記入   |
|  |      | 10週 | 10. 著作権法                              | 保護対象, 権利の効力           |
|  |      | 11週 | 10. 著作権法                              | 保護対象, 権利の効力           |
|  |      | 12週 | 11. 関連する条約                            | 特許, 意匠, 商標に関する国際条約の概要 |
|  |      | 13週 | 12. 事例検討<br>12-1. プログラム, データベースと知的財産権 | プログラムとデータベースの保護       |
|  |      | 14週 | 12-2. インターネットと知的財産権                   | インターネット利用に関わる知的財産権    |
|  |      | 15週 | 13. 知財の管理と会社経営                        | 知財を用いた企業戦略について理解する    |
|  |      | 16週 | 試験答案の返却及び解説                           | 試験問題の解説及びポートフォリオの記入   |

## モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標

| 分類    |         | 分野                              | 学習内容                            | 学習内容の到達目標                                                                                | 到達レベル | 授業週                                                                                     |
|-------|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 基礎的能力 | 人文・社会科学 | 社会                              | 地歴                              | 産業活動（農牧業、水産業、鉱工業、商業・サービス業等）などの人間活動の歴史的発展過程または現在の地域的特性、産業などの発展が社会に及ぼした影響について理解できる。        | 2     | 前1,前10,後1,後2,後6,後7,後8,後10,後12,後15                                                       |
|       |         |                                 |                                 | 社会や自然環境に調和した産業発展に向けた現在までの取り組みについて理解できる。                                                  | 2     | 前1,前10,後1,後6,後15                                                                        |
|       | 工学基礎    | 技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史 | 技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史 | 技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を理解し、社会における技術者の役割と責任を説明できる。                                         | 4     | 前2,前3,前4,前5,前6,前7,前8,前11,前12,前13,前14,前15,前16,後1,後2,後3,後4,後5,後6,後7,後8,後9,後10,後11,後12,後15 |
|       |         |                                 |                                 | 説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者の行動に関する基本的な責任事項を説明できる。                                         | 4     | 前2,前3,前4,前5,前6,前7,前8,前11,前12,前13,前14,前15,前16,後1,後2,後3,後4,後5,後6,後7,後8,後9,後10,後11,後12,後15 |
|       |         |                                 |                                 | 技術者を目指す者として、社会での行動規範としての技術者倫理を理解し、問題への適切な対応力（どのように問題を捉え、考え、行動するか）を身に付けて、課題解決のプロセスを実践できる。 | 4     | 前2,前3,前4,前5,前6,前7,前8,前11,前13,前14,前15,前16,後1,後2,後3,後4,後5,後6,後7,後8,後10,後11,後12,後15        |
|       |         |                                 |                                 | 情報技術の進展が社会に及ぼす影響、個人情報保護法、著作権などの法律について説明できる。                                              | 4     | 前1,前14,前15,後13,後14                                                                      |
|       |         |                                 |                                 | 知的財産の社会的意義や重要性の観点から、知的財産に関する基本的な事項を説明できる。                                                | 4     | 前9                                                                                      |
|       |         |                                 |                                 | 知的財産の獲得などで必要な新規アイデアを生み出す技法などについて説明できる。                                                   | 4     | 前9                                                                                      |
|       |         |                                 |                                 | 技術者の社会的責任、社会規範や法令を守ること、企業内の法令順守(コンプライアンス)の重要性について説明できる。                                  | 4     | 前7,後13,後14                                                                              |
|       |         |                                 |                                 | 技術者を目指す者として、諸外国の文化・慣習などを尊重し、それぞれの国や地域に適用される関係法令を守ることの重要性を把握している。                         | 4     | 前7,後12,後13,後14                                                                          |
|       |         | 技術史                             | 技術史                             | 歴史の大きな流れの中で、科学技術が社会に与えた影響を理解し、自らの果たしていく役割や責任を理解できる。                                      | 3     | 前10,後13,後14                                                                             |

## 評価割合

|               | 定期試験 | レポート | 合計  |
|---------------|------|------|-----|
| 総合評価割合        | 80   | 20   | 100 |
| 知識の基本的な理解     | 60   | 0    | 60  |
| 思考・推論・創造への適応力 | 0    | 10   | 10  |

|                  |    |    |    |
|------------------|----|----|----|
| 汎用的技能            | 0  | 10 | 10 |
| 態度・志向性（人間力）      | 0  | 0  | 0  |
| 総合的な学習経験 と創造的思考力 | 20 | 0  | 20 |